

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2008 年 4 月 10 日 (10.04.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/041578 A1

(51) 国際特許分類:

G11B 5/84 (2006.01) C23C 16/50 (2006.01)
C23C 16/27 (2006.01) C23C 16/56 (2006.01)

SINGAPORE PTE.LTD.) [SG/SG]; 638552 リンク 2
ツアス # 3 Singapore (SG).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2007/068656

(72) 発明者; および

(22) 国際出願日: 2007 年 9 月 26 日 (26.09.2007)

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 阿山 兼士
(AYAMA, Kenji) [JP/SG]; 638552 リンク 2 ツアス #
3 ホーヤマグネティクス シンガポール プライベ
トリミテッド内 Singapore (SG).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(74) 代理人: 藤村 康夫 (FUJIMURA, Yasuo); 〒1070062
東京都港区南青山 2 丁目 2 番 1 5 号 ウィン青山
8 3 4 号 Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

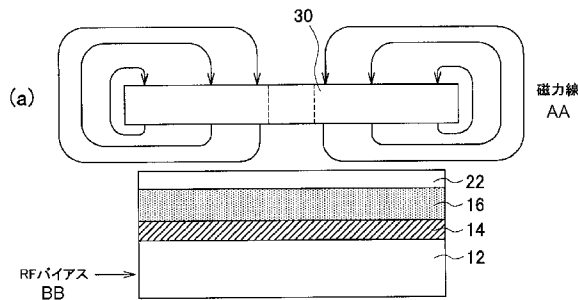
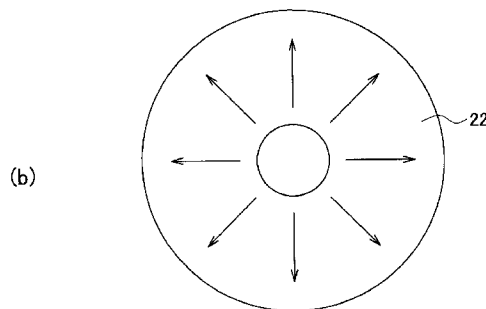
特願2006-262424 2006 年 9 月 27 日 (27.09.2006) JP

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH,
BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について):
HOYA 株式会社 (HOYA CORPORATION) [JP/JP];
〒1618525 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号
Tokyo (JP). ホーヤマグネティクス シンガポール
プライベートリミテッド (HOYA MAGNETICS

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND METHOD FOR MANUFACTURING LAMINATED BODY

(54) 発明の名称: 磁気記録媒体の製造方法、及び積層体の製造方法



AA. MAGNETIC LINE
BB. RF BIAS

(57) Abstract: [PROBLEMS] To have a thin film suitably function even when the thickness of the thin film is reduced. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] Provided is a method for manufacturing a magnetic recording medium by forming a thin film on a substrate (12). The method is provided with a thin film forming step of forming the thin film by using a substance brought into the plasma state as a material. In the thin film forming step, the thin film is formed by using a material substance gathering means (30) for gathering the substance brought into the plasma state to the periphery of the substrate. The material substance gathering means (30) gathers the substance brought into the plasma state, for instance, to the periphery of the substrate (12) by generating a magnetic field at the periphery of the substrate (12).

(57) 要約: [課題] 薄膜の膜厚を低減した場合であっても、薄膜の機能を適切に発揮させる [解決手段] 基板 12 上に薄膜を形成する磁気記録媒体の製造方法であって、プラズマ化した物質を材料に用いて薄膜を形成する薄膜形成工程を備え、薄膜形成工程は、プラズマ化した物質を基板の周辺に集める材料物質集中手段 30 を用いて、薄膜を形成する。材料物質集中手段 30 は、例えば基板 12 の周囲に磁場を発生させることにより、プラズマ化した物質を基板 12 の周辺に集める。



WO 2008/041578 A1



OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

添付公開書類:
— 国際調査報告書